

Teilnehmerliste Europäisches CMP and WET Users Meeting 2019

24.10.2019 - 25.10.2019

Name	Firma	Land	Ort
Awdshiew, Michael	Veeco GmbH	GER	Aschheim
Balan, Viorel	CEA-LETI	FRA	Grenoble
Bartha, Johann W.	TU-Dresden	GER	Dresden
Bergmann, Christian	Qualcomm	GER	München
Boldt, Stephan	Osiris International GmbH	GER	Moos
Bornhorst, Kirstin	Fraunhofer IPMS	GER	Dresden
Bott, Sascha	Globalfoundries	GER	Dresden
Breul, Alexander	intelligent fluids GmbH	GER	Leipzig
Buekenhoudt, Koen	IMEC	BEL	Blanden
Chabourel, Alain	EBARA Precision Machinery Europe GmbH	GER	Hanau
Chen, Xu	RENA Technologies GmbH	GER	Gütenbach
Choi, Chan Young	EBARA Precision Machinery Europe GmbH	GER	Dresden
Coyle, Aidan	Seagate Technology	GBR	Strabane
De Groot, Rein	SPS Europe GmbH	NLD	Putten
De Leersnijder, Koen	IMEC	BEL	Gingelom
Dedic, Alen	Qualcomm RF360 Europe GmbH	GER	Munich
Demmler, Marcel	scia Systems GmbH	GER	Chemnitz
Diaz De Zerio, Amaia	IMEC	BEL	Leuven
Didet, Fabrice	EBARA Precision Machinery Europe GmbH	FRA	Jarrie
Dieckhoff, Thomas	Kinetics Germany GmbH	GER	Eschau-Hobbach
Dietrich, Andreas	Kinetics Germany GmbH	GER	Eschau-Hobbach
Dilly, Sebastian	Pall Microelectronics	GER	Dreieich
Doerr, Christian	Fujimi Europe GmbH	GER	Ingelfingen
Dörl, Sebastian	Versum Materials	GER	Radeburg
Dunkel, Christian	Fraunhofer IZM ASSID	GER	Moritzburg
Durix, Fabien	EBARA Precision Machinery Europe GmbH	GER	Hanau
Dussault, Don	ProSys	GER	Stockach
Eckel, Michael	SPS Europe GmbH	GER	Ingolstadt
Eichinger, Igor	intelligent fluids GmbH	GER	Leipzig
Fittkau, Jens	MKS Instruments Deutschland GmbH	GER	München
Fuchs, David	AMS AG	AUT	Graz
Gampe, Felix	Osiris International GmbH	GER	Moos
Gansauer, Peter	Fraunhofer Institut	GER	Moritzburg
Gay, Xavier	RENA Technologies GmbH	GER	Freiburg
Gebhardt, Thomas	AP&S International GmbH	GER	Donaueschingen
Gillot, Christophe	DuPont	GER	Neu-Isenburg
Givens, John	Applied Materials, Inc	USA	Austin
Gottfried, Knut	Fraunhofer ENAS	GER	Chemnitz
Guhl, Conrad	Fraunhofer IPMS	GER	Dresden
Gunji, Yoshihiro	EBARA Precision Machinery Europe GmbH	GER	Hanau
Haas, Günter	Entegris	FRA	Moirans
Haft, Anna	Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. KG	GER	Dresden
Hammerl, Bernhard	Siconnex customized solutions GmbH	AUT	Hof bei Salzburg
Hanotte, Marc	ENTEGRIS	FRA	Moirans
Hauck, Michael	DuPont	GER	Neu-Isenburg
Haupt, Ronny	Nova Measuring Instruments	GER	Dresden
Haxhijaj, Ina	IMS Chips	GER	Stuttgart
Henderson, Richard	EBARA Precision Machinery Europe GmbH	GBR	Darlington
Herrmann, Katrin	Siltronic AG	GER	Freiberg
Hunt, Carl	Fujimi Europe GmbH	GER	Ingelfingen
Jäger, Nina	AMS AG	GER	Premstätten
Kappel, Joscha	Fraunhofer IPMS	GER	Dresden
Kaschowitz, Manuel	AMS AG	AUT	Graz
Kaszas, Philipp	intelligent fluids GmbH	GER	Leipzig

Kiesel, Axel	Robert Bosch Semiconductor Manufacturing Dresden GmbH	GER	Dresden
Klaushofer, Markus	Siconnex customized solutions GmbH	AUT	Hof bei Salzburg
Kober, Christian	Applied Materials	GER	Dresden
Kollien, Thomas	SMC Austria GmbH	AUT	Korneuburg
Kraus, Harald	Lam Research	GER	Dresden
Kulawski, Martin	Advaplan Inc.	FIN	Kauniainen
Künzelmann, Ulrich	TU Dresden Institut für Halbleiter- und Mikrosystemtechnik	GER	Dresden
Lisker, Marco	IHP GmbH	GER	Frankfurt (Oder)
Lutz, Georg	Pall Microelectronics	GER	Dreieich
Martinka, Ronny	Fraunhofer ENAS	GER	Chemnitz
Marx, David	Hitachi Chemical Europe GmbH	GER	Düsseldorf
McCarney, Colin	Seagate	GBR	Londonderry
McGrenaghan, Seamus	Seagate	IRL	Letterkenny
McKeever, Peter	TWI	USA	Sunnyval
Moser, Janos	Eminess Technologies	CHE	Fruthwilen
Müller, Uwe	Amcoss GmbH	AUT	Feldkirch
Nadler, Roger	IMT AG	CHE	Greifensee
Natzer, Stephanie	Fraunhofer IISB	GER	Erlangen
Neuhäuser, Martin	SMC	CZE	Sychrov
Nouwens, Jurgen	CCT Europe bv	NLD	Helmond
O'Hara, Paul	Seagate Technology (Ireland) Ltd.	GBR	Derry
Oberhauser, Harald	EBARA Precision Machinery Europe GmbH	GER	Sauerlach
Oshinowo, John	DeviceWater GmbH	GER	Hamburg
Pastor, Björn	EBARA Precision Machinery Europe GmbH	GER	Dresden
Perchinig, Harald	NexGen Wafer Systems	AUT	Villach
Peters, Hans	PTW Europa GmbH	GER	Dresden
Poladli, Polad	XFAB	GER	Dresden
Rämisch, Robert	Entegris	GER	Dresden
Reinhold, Birgit	GLOBALFOUNDRIES	GER	Dresden
Reinhold, Frank	Infineon Technologies Dresden GmbH	GER	Dresden
Richter, Reinhart	EBARA Precision Machinery Europe GmbH	GER	Hanau
Ridremont, Romain	JSR Micro NV	BEL	Leuven
Riedel, Thomas	S3-Alliance	GER	Reutlingen
Rieder, Robert	TELTEC Semiconductor Technic GmbH	GER	Mainhardt
Rozema, Cor	SPS Europe GmbH	NLD	Putten
Sakalauskas, Egidijus	Nova Measuring Instruments	GER	Dresden
Schlick, Hans-Dieter	Fraunhofer IMS	GER	Duisburg
Schloetzer, Thomas	RENA Technologies GmbH	GER	Berg
Schmidt, Ronny	Kinetics Germany GmbH	GER	Eschau-Hobbach
Schoenhofen, Walter	3M Deutschland GmbH	GER	Neuss
Schratzberger, Andreas	SMC Austria GmbH	AUT	Korneuburg
Schubert, Ina	Fraunhofer ENAS	GER	Chemnitz
Schussmann, Stefan	Levitronix GmbH	CHE	Zuerich
Shepherd, Paul	3M UK plc	GBR	Atherstone
Steible, Benjamin	Fraunhofer ISIT	GER	Itzehoe
Steinke, Philipp	Fraunhofer IPMS	GER	Dresden
Stoekli, Simon	Levitronix GmbH	CHE	Zuerich
Storms, Bavo	IMEC	BEL	Roosbeek
Straka, Joachim	SONOSYS Ultraschallsysteme GmbH	GER	Neuenbuerg
Suhle, Reinhard	Applied Materials	GER	Dresden
Taddei, John	Veeco	GBR	Horsham
Tagawa, Yoshikazu	AGC Inc.	JPN	Chiyoda-ku
Tanaka, Hirohisa	Hitachi Chemical Europe GmbH	GER	Dusseldorf
Tsvetanova, Diana	IMEC	BEL	Leuven
Tustin, Michael	Ensinger Inc.	USA	Washington
Vandersmissen, Kevin		BEL	Tervuren
Wachsmuth, Holger	Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration	GER	Moritzburg
Wahlicht, Sven	XFAB Dresden	GER	Dresden
Walter, Konrad	Obducat Europe GmbH	GER	Radolfzell

Weitzmann, Anne
Winker, Bernard
Witnik, Ulrike
Zwicker, Gerfried

Fraunhofer IPMS
RENA Technologies GmbH
Infineon Technologies Dresden GmbH
zwickerconsult

GER Dresden
GER Gütenbach
GER Dresden
GER Itzehoe